# AccuTOF 納入講習テキスト Windows7 Version

日本電子㈱

Ι	装置	置の立上げ	3
	I-1	電源投入&排気開始	3
	★検出器	器(MCP)の慣らし運転について	3
	<i>I</i> −2	<i>ES I プローブ</i>	3
I	システ	Fム	4
	<u> </u>	アイコン説明	4
	<u>I</u> I-2	MassCenter の起動	5
	<i>∏-3</i>	MassCenter のメニューについて	5
	<u> </u>	プロジェクトの作成	6
	<b></b>	MS調整マネージャーのメニューについて	8
Ш	Acc	c u TOFの調整	8
Ш	<u>-1</u>	分解能&感度 調整	8
IV	測定	Ē	1
	<i>I</i> V – 1	MS測定条件の編集	1
	<i>N</i> -2	Agilent1100 測定条件の編集	2
	<i>W</i> -3	キャリブレーション(質量校正)	3
	<i>W</i> -3	測定	8
	W-3-	-1 単発測定	8
	W-3-	-2 Sample List による連続測定	11
	W-3-	ー3 Sample List の作成	
	W-3-	-4 連続測定の開始	15
	W-3-	-5 連続測定の中止	16
V		解析	17
	V-1	解析 <クロマト処理>	17
	V-2	解析 <スペクトル処理>	18
	V-3	解析 <精密質量処理>	19
VI	装置の	D停止	28
	<i>V</i> /− 1	短期停止	28
	W-2	長期停止(シャットダウン)	29
VII	<b>イオン</b>	ノ源のメンテナンンス要領	30
	W — 1	イオン源洗浄要領	31

VI - 1 - 1	日常的な洗浄	32
₩-1-2	分解洗净 [	33
Ⅷ-1-3 左	}解洗净Ⅱ	35
//////////////////////////////////////	分解洗净Ⅲ	36
<i>I</i> II−2 Ľ−	ター及び白金測温体交換要領	38
<i>I</i> II−2−1	オリフィス	38
<i>I</i> II−2−2	ベーパライザー	39
<i>™</i> −3 <i>z</i>	プレーヤーの分解及び組立要領	39
‴−4 消耗	<b>託品及び定期交換部品について</b>	41
//////////////////////////////////////	オリフィス	41
<i>I</i> II−4−2	イオン源覗き窓	41
<i>I</i> -4−3	スプレーヤーガイド	42

# I 装置の立上げ

#### I-1 電源投入&排気開始

- 1)背面のブレーカーを『ON』
- 2) 電源 ON(装置前面)
- 3) 窒素ガスの供給 600kpa 以上の圧力が必要
- 4) EVAC ON (排気開始) (窒素ガス圧力計が、600kpa 以上ないとスタートしない)



Ready ランプが点滅から点灯に変わることで、排気完了となります。

検出器(MCP)保護のため、排気完了から15時間後に高電圧が印加可能になります。 (システム側で制御しています)

排気完了の目安(点滅→点灯)

●真空度: 1.2×10-4Pa 以下

#### ★検出器 (MCP) の慣らし運転について

検出器(MCP)は極微細管構造になっており、表面に酸素等が付着した状態で高電圧を印加すると、放電効果により微細管表面を損傷させてしまいます。

DRYING GAS

• EVAC

VENT

電源ON

·電源OFF

NEBULIZING

正面パネル

GAS

NEEDLE 1

NEEDLE 2

HEATER

AccuTOF では検出器保護のため、真空立ち上げ後(EVAC Ready) 1 5時間経過しないと高電圧が印加できないようにシステム側で制御しています。

実際のご使用にあたっては、検出器保護のため、高電圧をゆっくりと印加して、検出器を"慣らす"必要があります。

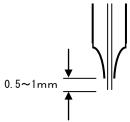
『MS調整マネージャー』→『装置』→『MCP検出器の慣らし』を選択し、

『停止電圧』を使用する電圧に設定し、『慣らし時間』を 60min に設定して"検出器の慣らし"操作を実行してください。



#### I-2 ESIJD-J

ESI 先端キャピラリーは、0.5~1mm に合わせます。



# Ⅱ システム

# 1. システムの起動

・ログインする

パスワード: JEOL (表示は\*\*\*\*となります)

# Ⅱ-1 アイコン説明

AccuTOFでは下記に示すアイコンで全ての操作を行います。

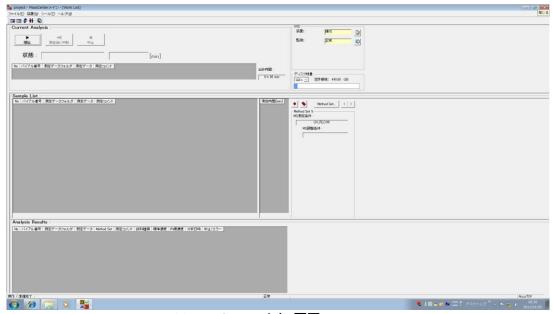
MassCenterメイン.Ink	MassCenterメインプログラム このプログラムで MS 調整、測定、解析を行います。 すべてはここから始まります。
JEOL ESI	デコンボルーションプログラム
Deconvolutio	AccuTOFで測定したデータをデコンポルーション演算するプログラムです。
ラ 回	<b>データマネージャプログラム</b>
データマネージャ	各種分析条件・データ等のファイルメンテナンスプログラムです。
MS監視ビュー	装置監視パネルプログラム
ワ	AccuTOF のアラーム、各ユニット電圧のモニタープログラムです。
©rop MassCenterS TOP	MassCenterストッププログラム MassCenterで、動作中のプログラムを全て停止させます。 MassCenterメインプログラムで正常終了しない場合、 動いたままになっているプログラムを強制終了させることができます。

# Ⅱ - 2 MassCenter の起動



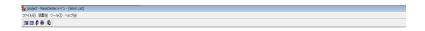
MassCenter アイコンをダブルクリックする





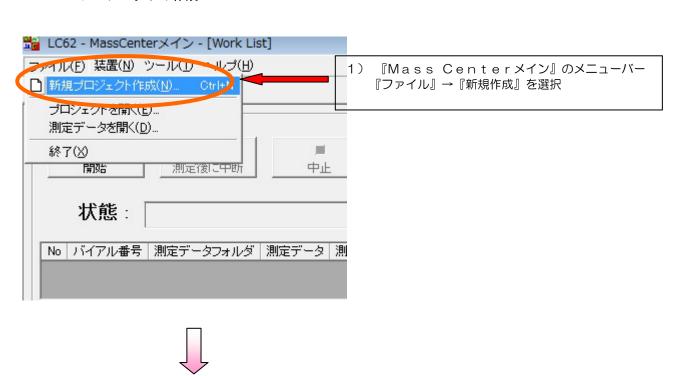
Mass Centerメイン画面

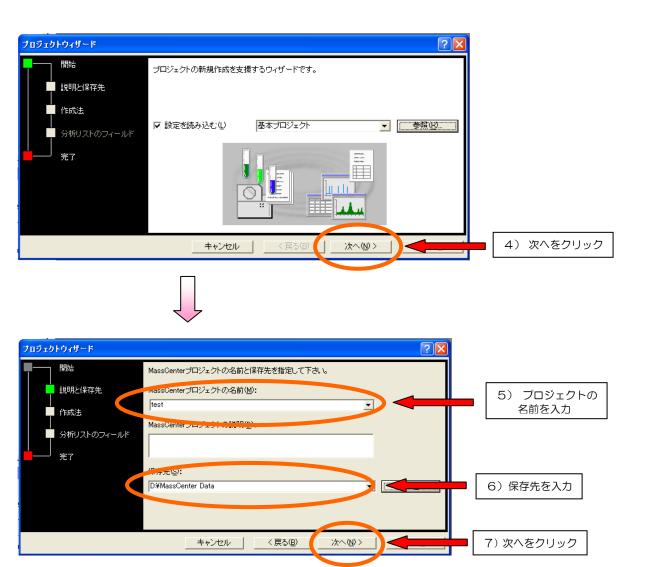
# II - 3 MassCenter のメニューについて

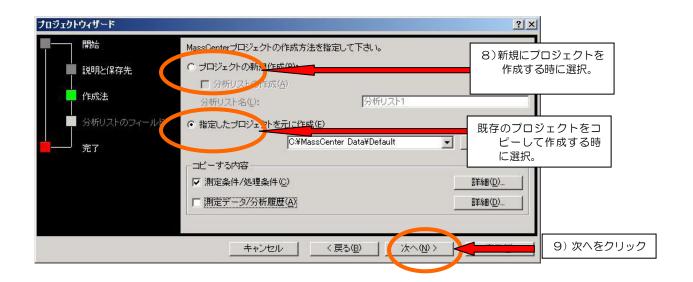


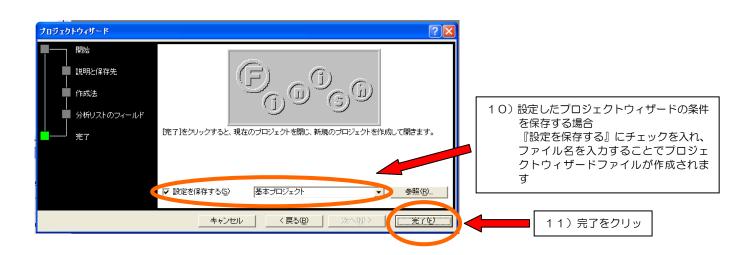
メニュー	下層メニュー	内 容
	MS調整(T)	感度・分解能調整画面へ
	MS測定条件(M)	測定条件編集画面へ
装置(N)	質量校正(C)	キャリブレーション画面へ
	試料導入部条件(L)	LC制御画面へ
	装置監視パネル(S)	MS&LCの状態観察画面へ
	組成推定(F)	組成推定画面へ
ツール(T)	同位体シュミレータ(I)	同位体シュミレーション画面へ
)— <i>I</i> V(1)	周期表(P)	周期律表画面へ
	一般定量(Q)	定量画面へ

# Ⅱ-4 プロジェクトの作成









# Ⅱ-5 MS調整マネージャー画面について



『Mass Center』のメニューバーの 『装置』→『MS調整』で MS調整マネージャーが立ち上がります。



#### Ⅱ-6 MS調整マネージャーのメニューについて



メニュー	下層メニュー	内 容
	スペクトルモニター(S)	最大スペクトル表示可能
	真空度(V)	真空度画面の表示
+ - 4 4	イオン源(I)	イオン源画面の表示
表示(V)	分析部(N)	分析部画面の表示
	分析部拡張(E)	分析部拡張画面の表示
	検出部(D)	検出部画面の表示
装置(N)	イオン化モード(I)	イオン化モードの切替え
表世(IN)	装置モード(M)	排気完了・ウオームアップ・待機・操作
モニタ(M)	表示範囲(D)	SCAN範囲・時間等の設定
測定(A)	単発測定(C)	1Shot 分析
ツール(T)	アベレージャーのノイズ係数(N)	ノイズ補正を行います。 装置納入時のみ使用します。

#### AccuTOFの調整 Ш

# Ⅲ-1 分解能&感度 調整

サンプル例:レゼルピン 500ppb

導入方法:調整用吸引ボトル

: またはシリンジポンプ

1) MS調整条件ファイルの読み込み

#### 重要!!

LCには絶対に高濃度(ppm以上)の <mark>レゼルピンを</mark>入れないでください! LC内部に残ってしまい、配管交換が 必要になることがあります。

このファイルを読込むことで、AccuTOF の全ての条件が切替わります。 『ファイル』→『MS調整条件ファイルを開く』で目的の調整条件を選択します。

#### 2)装置条件例 (装置により条件が異なります)

·分析部(拡張):飛行管電圧(7kV),

押し出し電圧(777V), 引き込み電圧(-777V)

・検出器:MCP(2300V~2500V程度)

・イオン源: ニードル電圧(2000V), オリフィス1電圧(10V),

> リングレンズ電圧(80V), オリフィス2電圧(5V)

・イオンガイド:ピーク間電圧(2000V)、バイアス電圧(27V)

・温度:オリフィス1(80°)、脱溶媒室温度(250°)



#### 3) SCANレンジの設定例

・スペクトルモニタ1の Window 内でマウスの右クリック → 『設定』を選択します。

・質量電荷比範囲 (m/z) の設定:m/z100~1,000

・スペクトル記録間隔: 0. 4sec

・待ち時間: O. O3sec

・データ収集間隔: 0.5 n s e c に設定します。 (納入時に設定しています)

#### 4) ビームの確認

Nebulizer gas : ON (Flowは 0.7L/min 程度) Dry gas ON (Flowは 2L/min 程度)

5) 調整 (tunning)

押し出しバイアス電圧(0Vから-1.0V程度)、収束レン四重極レンズ電圧(+20V程度)、左右電圧,上下電圧これらを組み合わせて分解能・感度を調整します。



#### 6) MS調整条件の保存

分解能・感度調整が完了したMSコンディションを『MS調整条件』として保存します。

『MS調整マネージャー』画面で 『ファイル』 → 『名前を付けて保存』で行います。

重要!! 保存したMS調整条件は実測定で用います

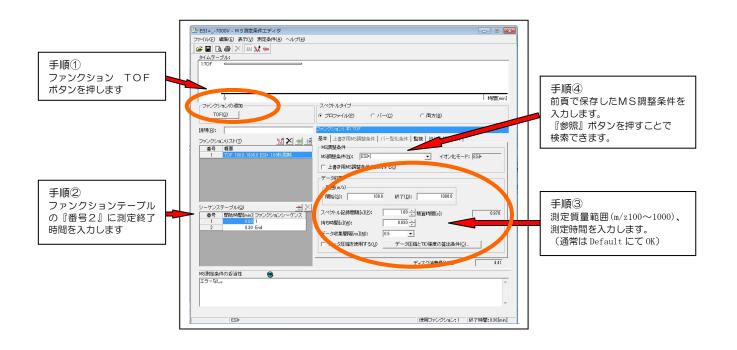
# IV 測定

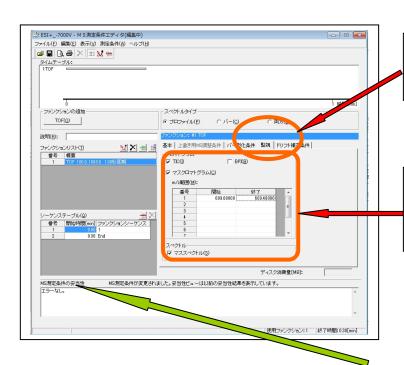
#### IV-1 MS測定条件の編集

- 1) MS測定条件の編集
  - ・『MassCenterメイン』のメニューバー 『装置』→『MS測定条件』を選択します



・下記手順で編集します





手順⑤ 『監視』を指定します。

手順⑥ リアルタイムモニター表 示に必要なTIC, マスクロ、マススペクト ルをチェックします。

・条件作成後、『ファイル』→『名前を付けて保存』で MS測定条件ファイルとして保存します。

# IV-2 Agilent1100 測定条件の編集

参考までに!

条件保存時に不適切なパラメータが 設定されると、『MS測定条件の妥当性』欄 に指摘事項が表示されます。 条件が適切であれば『エラー無し』の表示が出ます。

project - MassCenterメイン - [Work List]
ファイル(F) 装置(N) ツール(T) ヘルブ(H)

MS調整(T)...

Currer

Agricont HUD.

Agricont HUD.

Agricont HUD.

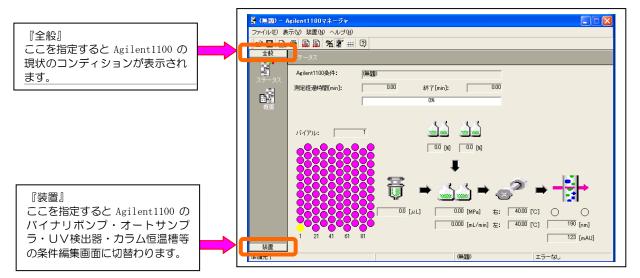
Agricont HUD.

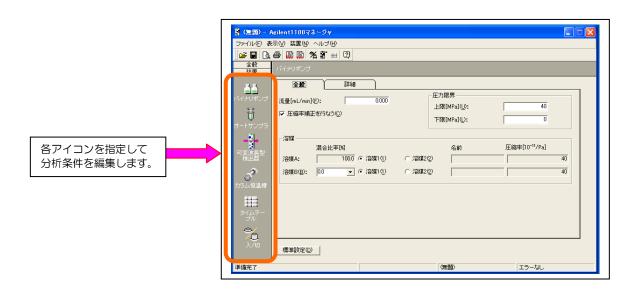
Agricont HUD.

P止

中止

注里##///





●条件作成後、『ファイル』→『名前を付けて保存』で Agilent1100 測定条件ファイルとして保存します

### Ⅳ-3 キャリブレーション(質量校正)

AccuTOFのキャリブレーションには"質量校正"と"質量ドリフト補正"の2種類があります。

# 質量校正:

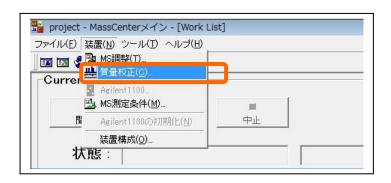
このデータを元に質量が校正されます。

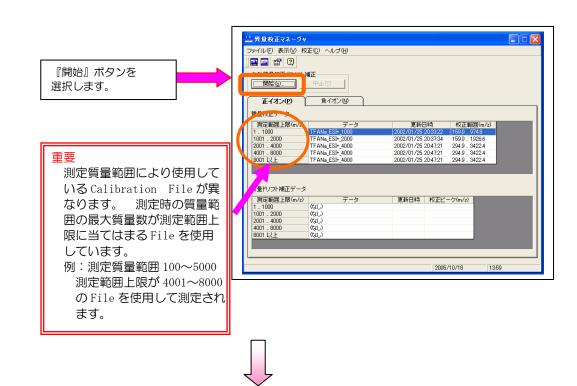
#### 質量ドリフト補正:

既知質量の成分を測定して、そのドリフト値を質量校正データに反映させます。

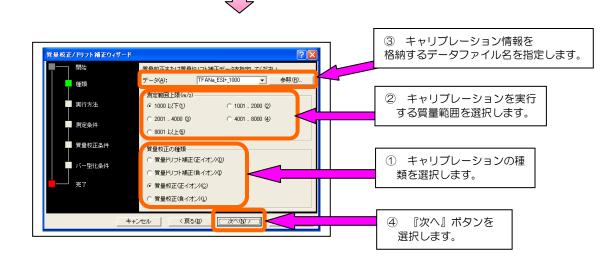
# ●質量校正の実行

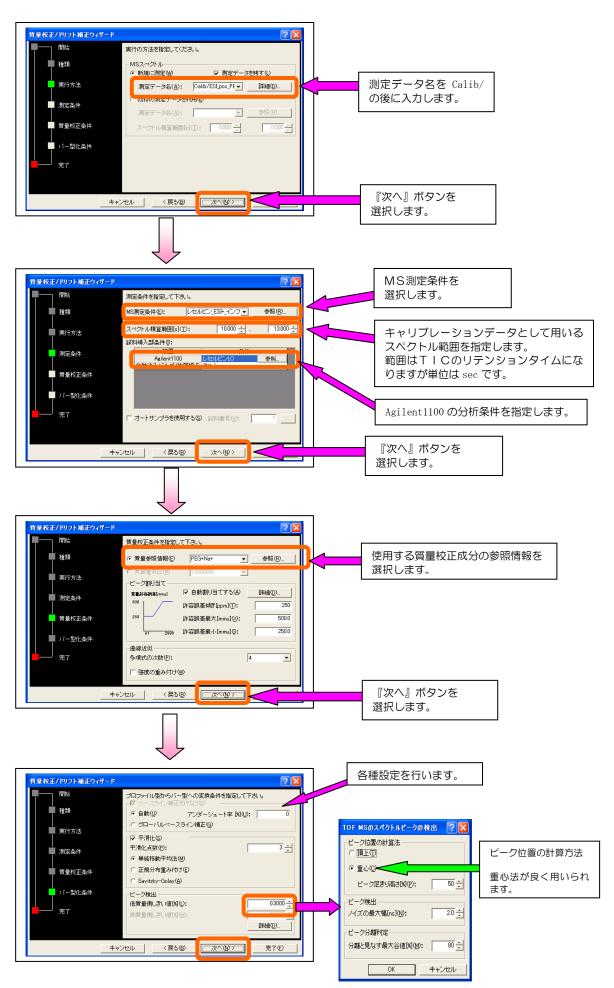
『MassCenter』→『装置』→『質量校正』を指定すると、『質量調整マネージャー』が立ち上がります

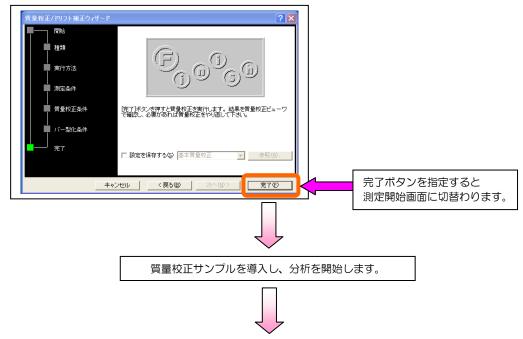




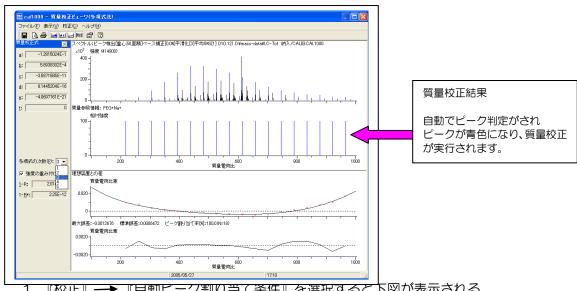




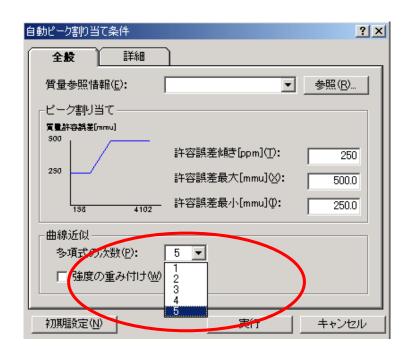




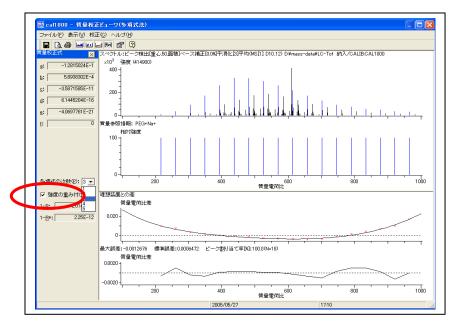
測定終了後、自動処理が始まり下図が表示されます。



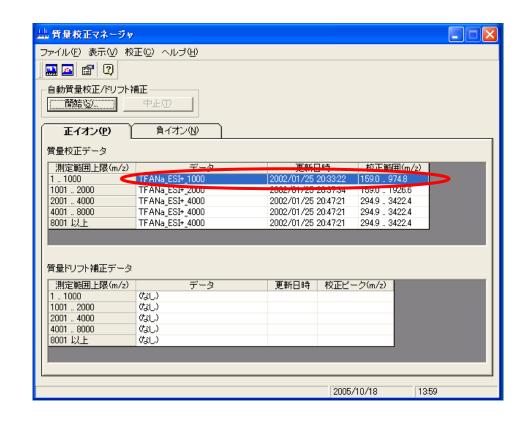
1.『校正』─▶『目動ヒーク割り当て条件』を選択すると下図が表示される。



2. 近似の多項式の次数を1~5まで変化させ"1-R☆"の値が一番小さな値を選択する。



- \*\* 1-R☆の値が5.0E-12以上の場合、ミリマス測定の精度が5ppm以内に入ら \*\*
- \*\* ない場合があります。その場合、サンプル濃度を上げるかサンプル自身を交換してみる。\*\*
- 3. 『ファイル』 → 『更新』を実施し、『ファイル』 → 『閉じて戻る』にて終了する。
- 4. 質量校正マネージャにて作成したキャリブレーションデータの更新日時を確認する。



\*\* MS調整マネージャのモニターは、マスレンジ等を変更しないと有効になりません。\*\*

#### Ⅳ-3 測定

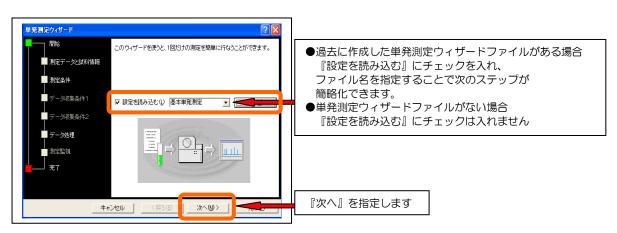
# Ⅳ-3-1 単発測定

●測定(単発測定)『MS調整マネージャー』の『測定』→『単発測定』を選択します。



・『単発測定ウィザード』が起動するので ウィザードの手順に従って測定準備を行います。

単発測定ウィザードS t e p①



# 単発測定ウィザードStep2



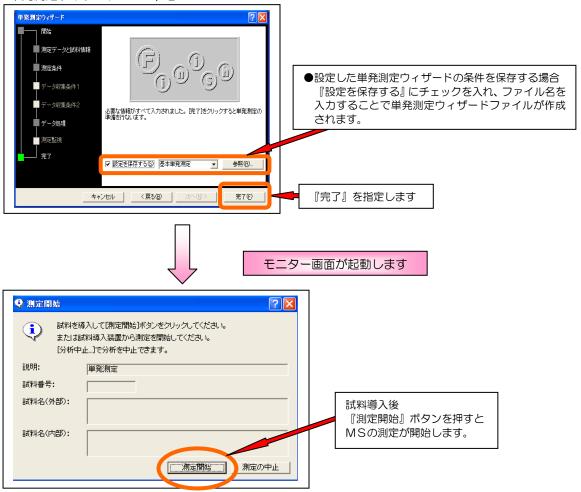
# 単発測定ウィザードStep③



# 単発測定ウィザードStep④



# 単発測定ウィザードStep⑤



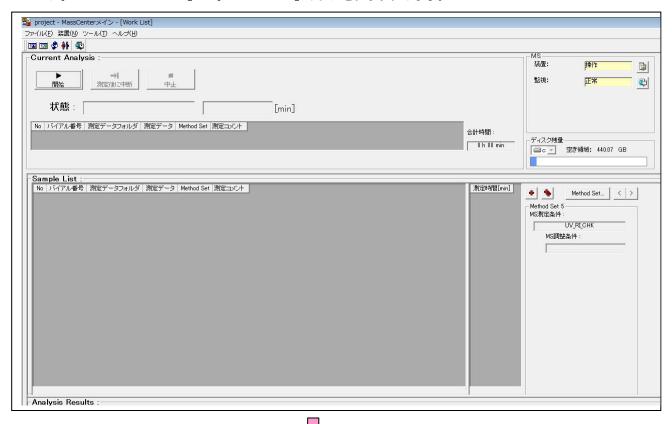
※※ オートサンプラー使用時は自動でスタートします ※※

# Ⅳ-3-2 Sample List による連続測定

Sample List は一連の分析を行ううえで必要な情報(測定データ名・データ格納ホルダー、MS&LC分析条件等)をリストとして登録して、リストの内容に基づいて測定を行うものです。 オートサンプラを使用した分析では分析前に作成しなければなりません。

#### ●Method Set の作成

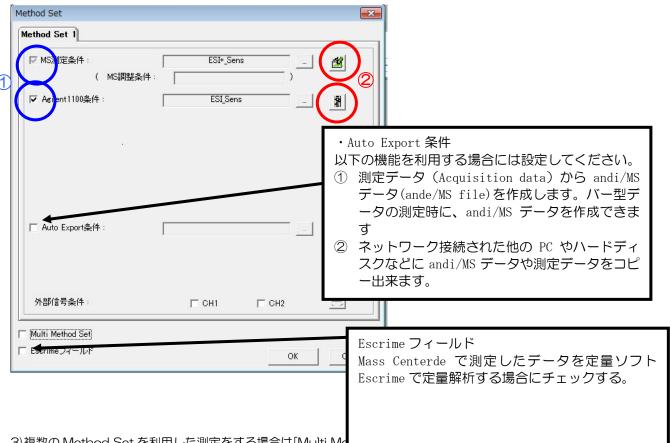
1) 『MassCenter』の『Method Set』ボタンをクリックします。



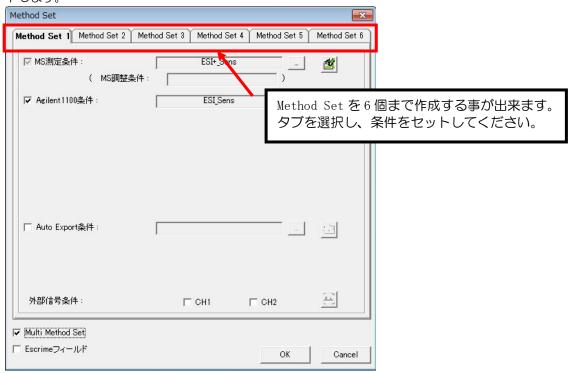


2) ①使用する条件にチェックマークを入れます。(MS 測定条件はチェックマークを外せません。) ②各アイコンをクリックし、条件を作成します。

既に条件を作成済みの場合は、 ボタンをクリックし、作成した条件を選択します。



3) 複数の Method Set を利用した測定をする場合は[Multi Mehots]。

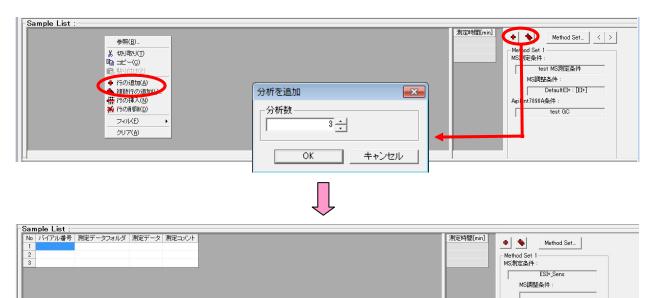


4)OK をクリックします。

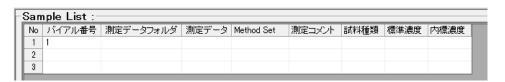
#### Ⅳ-3-3 Sample List の作成

連続測定前には、MassCenter メインでディスク残量の空き領域を確認してください。容量が残り少ない場合はデータをバックアップするなどして、空き容量をふやしてください。

1) Sample List 上で右クリックをして表示されるメニューから[行の追加]( ・ アイコン)または[複数行の追加]( ・ アイコン)を選択します Sample List に行が追加されます。

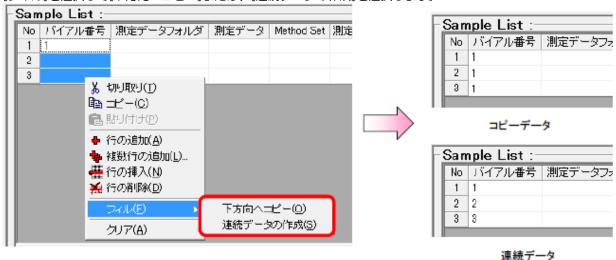


2) Sample List の各フィールドに設定を入力します。 [バイアル番号]にオートサンプラのバイアル番号を入力します。 ※オートサンプラを使用しない場合、すべてに『1』を入力して下さい。

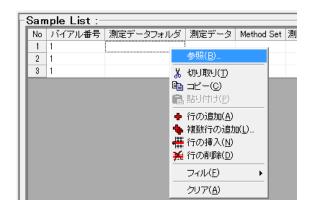


★下のセルにコピーする場合や、連続した番号を付ける場合は、番号を入力したセルから下方向にドラッグし範囲を 指定して右クリックでメニューを表示させます。

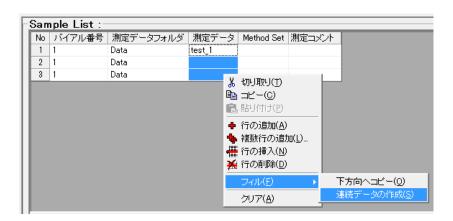
[フィル]を選択して[下方向ヘコピー]または、[連続データの作成]を選択します。



- 3) [測定データフォルダ] に測定データを保存するフォルダを選択します。
- ・既存の測定データフォルダを選択する場合は、左クリックでセルを選択し、右クリックして開くメニューから [参照]を選択してください。
- ・測定データフォルダを新規作成する場合は、セルを選択してフォルダ名をキー入力してください。

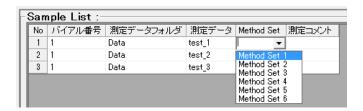


- ★連続して同一の内容を入力する時は、フィル機能を利用してコピーすると便利です。
  - 4) [測定データ] に測定データ名を入力します。 測定データ名に連続した番号を付ける場合はフィル機能を利用すると便利です。



5)[Method Set]を選択します。

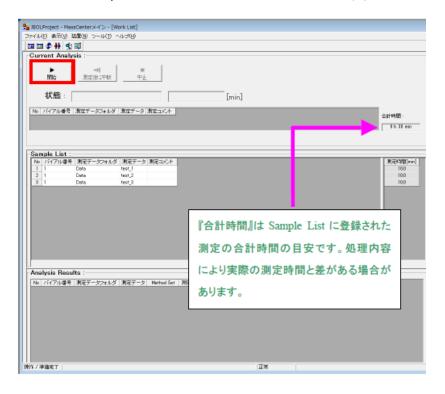
※Method Set 作成時に、[Multi Method Set]にチェックを入れた場合のみ表示されます。



- ★ 連続して同一の内容を入力する時は、フィル機能を利用してコピーすると便利です。
  - 6) [測定コメント]を任意で入力します。
  - 7) [試料種類]、[標準濃度]、[内標濃度]を入力します。
- ※Method Set 作成時、[Escrime フィールド]にチェックを入れた場合のみ表示されます。
- ★作成した Sample List はテキスト形式で保存する事が出来ます。メモ帳やワードパッドに保存してください。

# Ⅳ-3-4 連続測定の開始

Current Analysis 内の ボタンをクリックします。



Sample List の妥当性確認が実行されます。

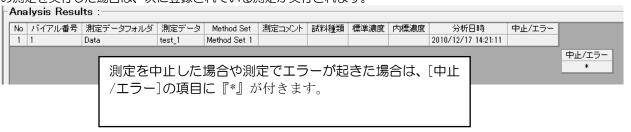


[不具合なし]

測定開始



測定が終了すると、『Current Analysis』に表示されていた測定は消え、『Analysis Result』に追加されます。複数の測定を実行した場合は、次に登録されている測定が実行されます。



# Ⅳ-3-5 連続測定の中止

・測定の中止

[Current Analysis]の[中止]ボタン をクリックすると、実行中の測定がただちに中止され、連続測定が終了されます。



・測定後に中断

[Current Analysis]の[測定後に中断]ボタン 無定像に中断 をクリックすると、現在の測定完了後に、連続測定が終了します。押された状態の[測定後に中断]ボタンを再び押すと、[測定後に中断]状態が解除され、次の測定が続行されます。



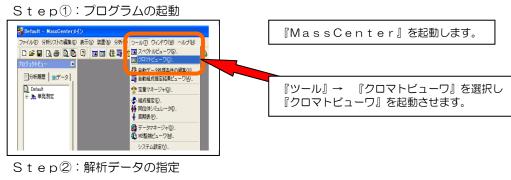
# Ⅳ-3-6 連続測定中の Sample List の編集

[Currnt Analysis]の[測定後に中断]ボタンをクリックすると、連続測定中に Sample List や Method Set を編集することができます。編集が終了したら、再び[測定後に中断]ボタンを押すと、[測定後に中断] 状態が解除され、編集した内容が登録されます。

[測定後に中断]が押された場合でも、連続測定中は Method Set ダイアログ内の[Multi Method Set]、[Escrime フィールド]の選択は変更できません。

# V 解析

# Ⅴ-1 解析 <クロマト処理>

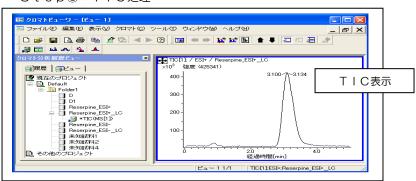


『クロマトビューワ』の『分析履歴ビュー』内の 解析したいデータを指定(左クリック)します。

指定後(青色に反転)、右クリックすることで メニューが表示します。 『開く』を選択することでクロマトグラムが 表示します。

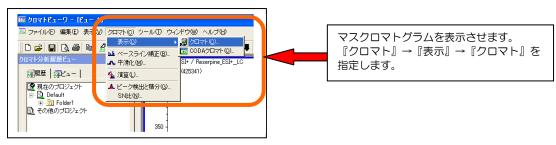
#### Step③:TIC処理

✓ ドッキングビュー(<u>k</u>)



★TIC処理方法 左ドラッグ(直線) → 指定範囲のクロマト拡大 左ドラッグ(囲み) → 囲み範囲のクロマト拡大

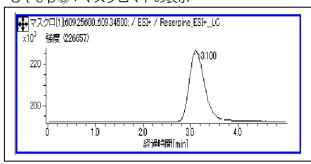
#### Step④:マスクロマトグラム処理



Step⑤:マスクロマト処理の設定

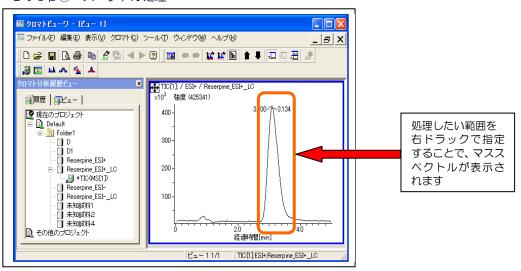


Step⑥:マスクロマトの表示



#### Ⅴ-2 解析 <スペクトル処理>

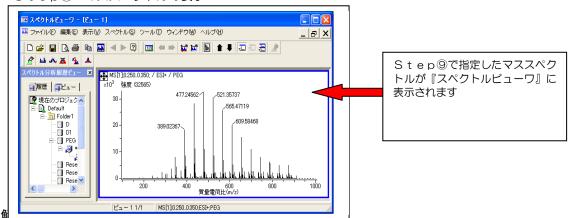
Step①:スペクトル処理



★クロマト処理 左ドラッグ(直線) → 指定範囲のクロマト拡大 左ドラッグ(囲み) → 囲み範囲のクロマト拡大

★スペクトル処理 右クリック → 指定ポイントのスペクトル表示 右ドラッグ → 囲み範囲の積算スペクトル表示

# Step②:マススペクトルの表示

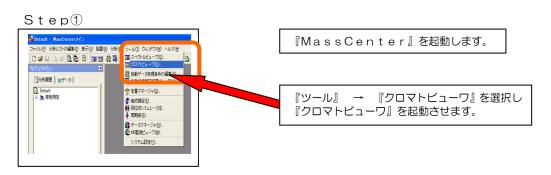


V - 3

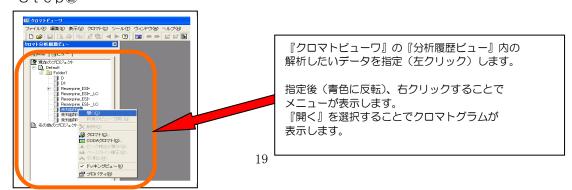
AccuTOF で精密質量測定を行う場合、内部標準物質として既知質量の成分を添加したサンプルを調製します。

内部標準物質の質量を基準に目的質量の校正が行われます。 内部標準物質の濃度としては 0.5ppm 程度が適当と思われます。 濃度が低すぎると十分な精度が得られない場合があります。

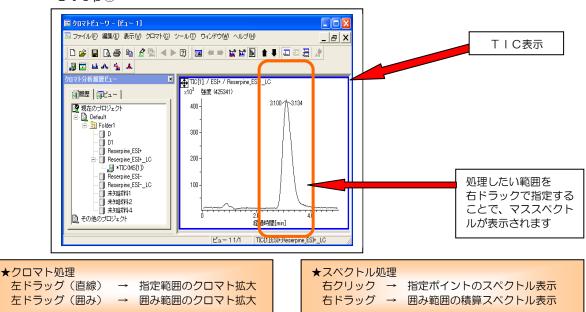
- ●調整方法 『測定』の項を参照ください
- ●MS調整条件の保存 『測定』の項を参照ください
- ●MS測定条件の編集 『測定』の項を参照ください
- ●測定 『測定』の項を参照ください
- ●解析 (ミリマス測定)



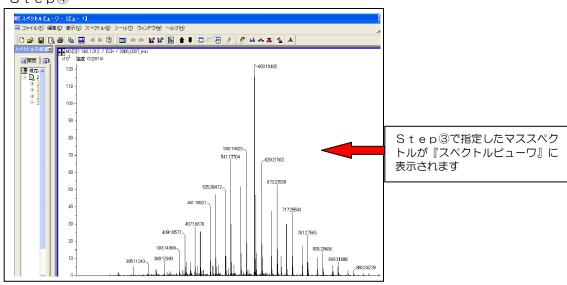
# Step2



#### Step3



#### Step4



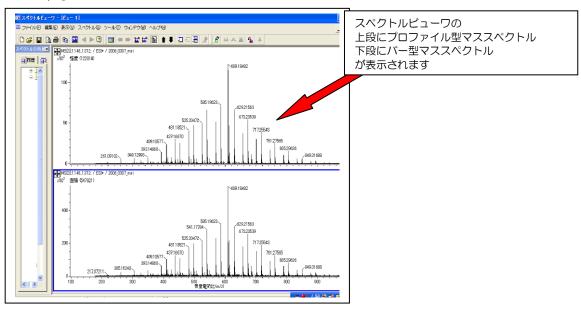
# Step5



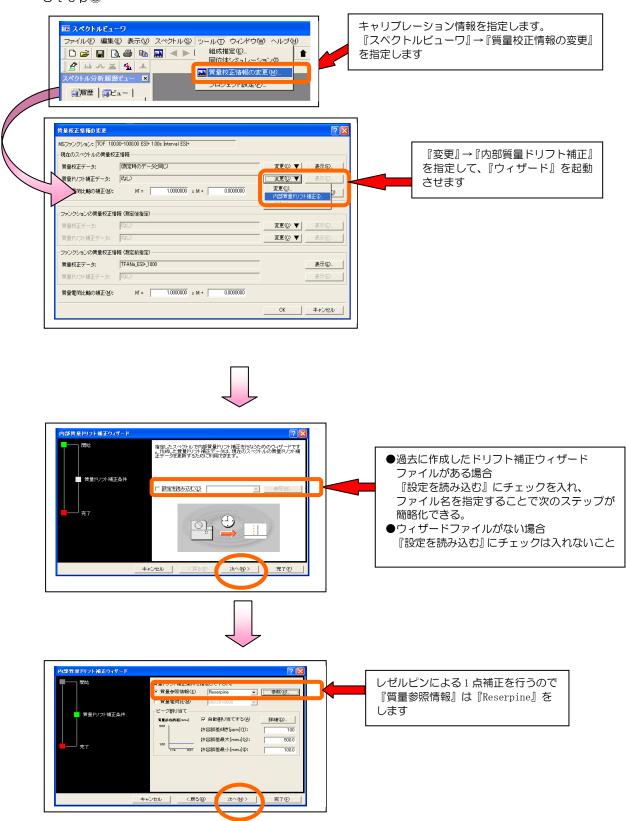
#### Step®



# Step7



#### Step®



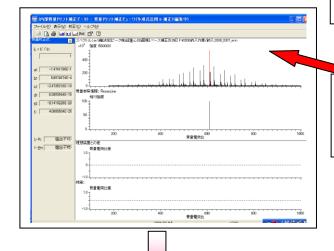


設定したウィザードの条件を保存する場合 『設定を保存する』にチェックを入れ、ファイル名を入力することで単発測定ウィザードファイルが作成されます。



『実行』ボタンを押すことで『質量参照情報』 としてレセルピンの参照ピークが表示されます。

1 段目: 測定データ 2 段目: 質量参照情報



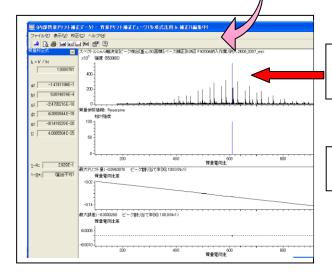
1 段目の測定データ中のレセルピンのピークをクリックして指定する。 → 『赤色』に反転

左ドラッグすることで拡大できるので ピーク指定がやり易くなります。



『質量ドリフト補正ビューワ』 → 『校正』 → 『ピークの割り当て』 → 『指定ピーク』 を選択することで

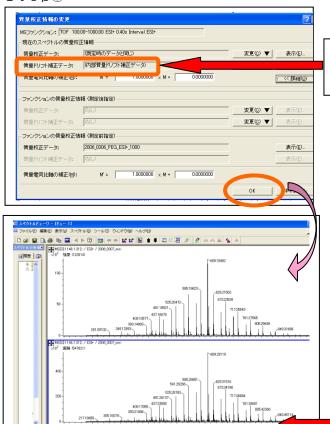
2段目の『質量参照情報』のレセルピンピークが内部標準としてキャリブレーションされます。



2段目の『質量参照情報』のレセルピンピークが内部標準としてキャリブレーションされると『**青色』**に反転します。

『ファイル』→『更新』→『閉じて戻る』を選択します。

#### Step9



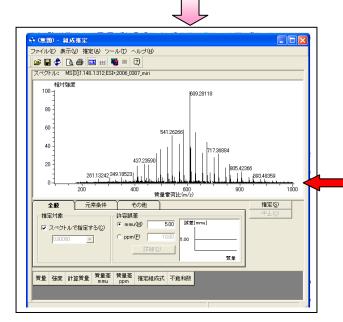
『質量ドリフト補正データ』が『なし』→ 『内部質量ドリフト補正データ』に変わってい ることを確認します。

下段のデータがドリフト補正後のデータに 変わります。

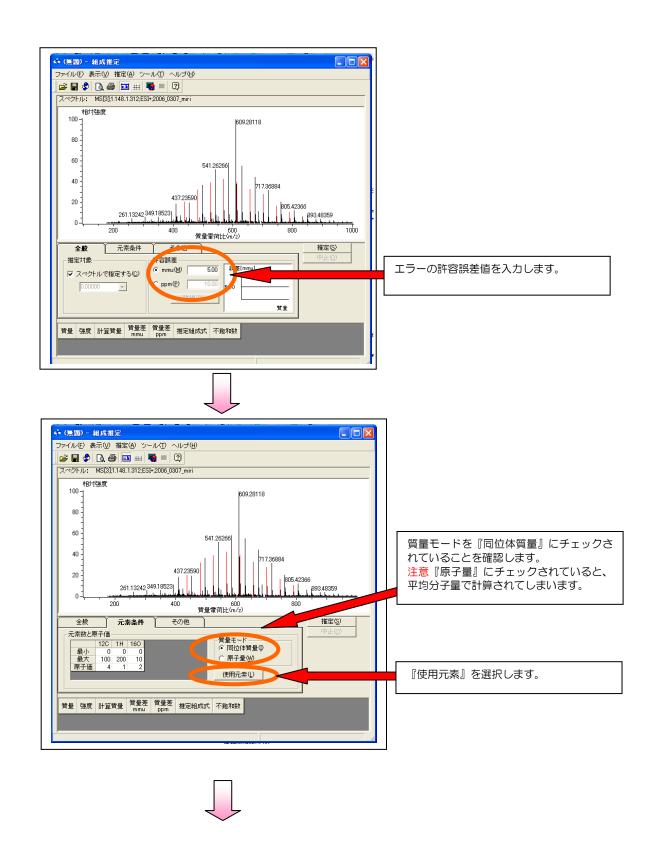
#### Step10

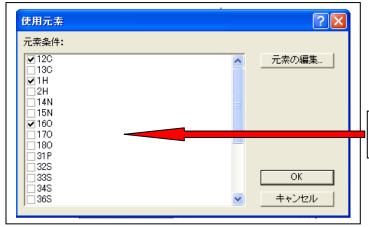


メニューバーの『ツール』→『組成推定』 を選択します。



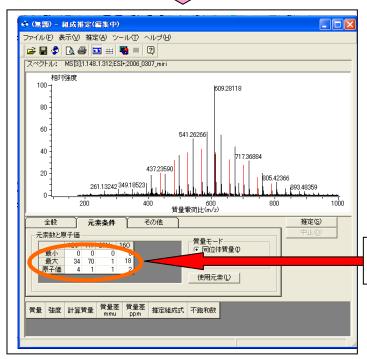
組成推定プログラムが起動します。





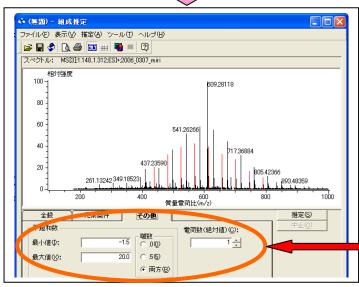
組成演算で必要な元素にチェックを入れ 指定します。指定後『OK』します。



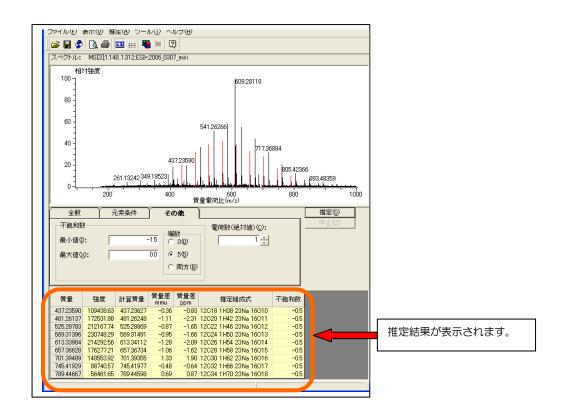


選択した元素の最大値、最小値をキー 入力します。





『その他』のタグで不飽和数、電荷数 の指定をします。指定後、『推定』を選 択し組成演算の実行をします。



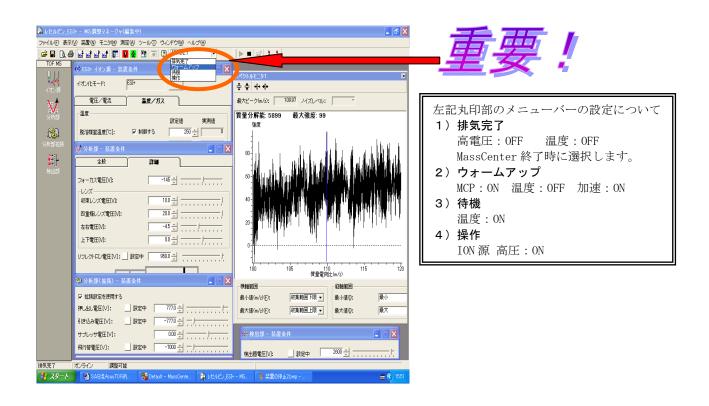
## VI 装置の停止

AccuTOF の停止方法は以下の2種類があります。

- ●短期停止(日常での停止方法)
- ●長期停止(シャットダウン方法)

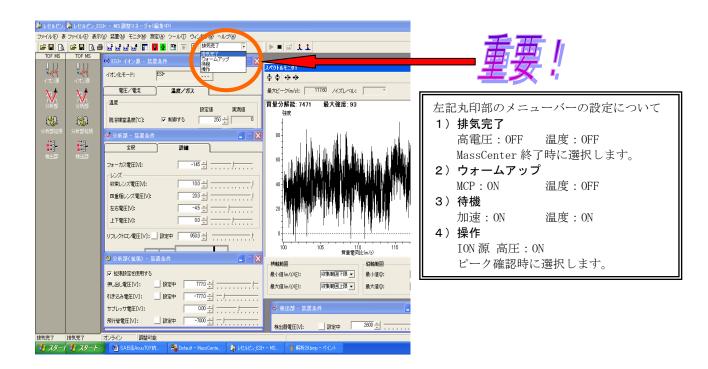
### Ⅵ-1 短期停止

- ①Nebulizer・脱溶媒ガスを OFF にします。
- ②日々の停止 → 装置状態を『ウォームアップ』状態にします。 一週間程度の停止 → 装置状態を『排気完了』状態にします。

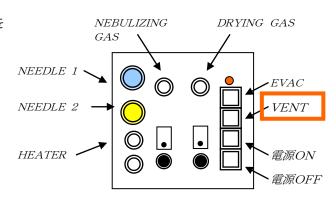


### Ⅵ-2 長期停止(シャットダウン)

- ①装置状態を『排気完了』状態にします。
- ②イオン源のヒータを OFF にします。
- ③Nebulizer・脱溶媒ガスを OFF にします。
- ④窒素ガスが600kpa以上の圧力がかかっていることを確認します。



- ⑤装置正面パネルの『VENT』ボタンを 押して真空を停止します。
- ⑥装置正面パネルの『電源OFF』 ボタンを押します。
- ⑦窒素ガスの供給を止めます。
- ⑧PC、プリンターの電源を切ります。



## Ⅲ イオン源のメンテナンンス要領

この項では、お客様が行うイオン源及びイオン導入部のメンテナンス作業について以下の順番で ご紹介します。

#### Ⅲ-1 イオン源洗浄要領

Ⅷ-1-1 日常的な洗浄

WI-1-2 分解洗浄 I WI-1-3 分解洗浄 II

Ⅲ-1-4 分解洗浄Ⅲ

Ⅲ-2 ヒーター及び白金測温体交換要領

Ⅲ-2-1 オリフィス

Ⅲ-2-2 ベーパライザー

Ⅲ-2-3 スプレーヤーの分解及び組立要領

Ⅶ-3 消耗品及び定期交換部品について

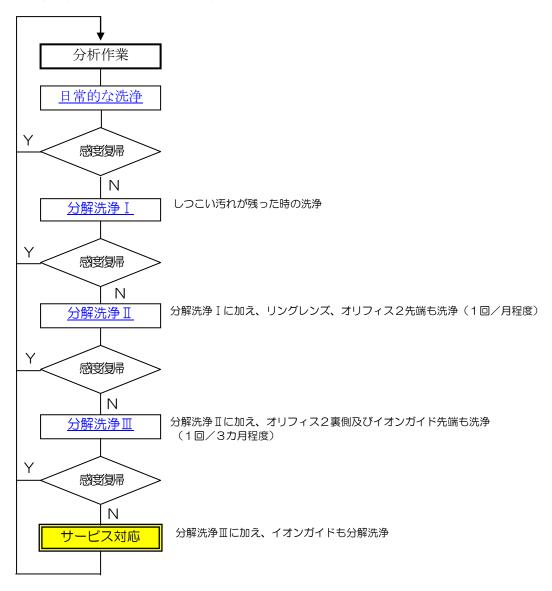
VII-3-1 オリフィス VII-3-2 イオン源覗き窓 VII-3-3 スプレーヤーガイド

## 【警告】

以下に説明するイオン源各部品の洗浄を行う前に、イオン源の操作(加熱、ガス導入、LC 稼働)を停止し、 ベーパライザー及びオリフィス1の温度が手で触れる事の出来る温度に低下した事を確認して下さい。 上記事項を守らないと溶媒蒸気を吸い込む、感電する、やけどを負う等の危険性があります。

## Ⅲ-1 イオン源洗浄要領

以下のフローチャートのように、汚れの度合により洗浄する項目が違います。以下に示した洗浄頻度は目安であり、お客様の使用状況により変わります。



#### 【 注意 】

イオンガイドの分解洗浄は専門のサービス員にお任せ下さい。お客様が分解洗浄・再組立を行った場合、分解能が復元しない可能性があります。

オリフィス1及びオリフィス2の取り扱いには十分注意して下さい。

ぶつける等でオリフィス周辺の形状が変化すると、感度が低下する可能性があります。

スプレーヤー先端のノズルを曲げないように取り扱いに注意して下さい。曲げると感度が不安定になる可能性があります。

# Ⅷ-1-1 日常的な洗浄

毎日を目安に、1日の測定開始前あるいは測定終了後に、以下の簡単な拭取洗浄を行って下さい。

1) イオン源を外します。



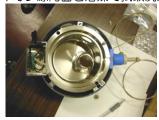




2) オリフィス1、テフロンリング及びドレンポートを溶媒で拭取洗浄します。 オリフィス1 (オリフィス径 0.4mm) にごみがついて穴を塞がないように注意して下さい。



3) イオン源内面を溶媒で拭取洗浄します。



4) スプレーヤーの金属部分を溶媒で拭取洗浄します。



拭取洗浄に使用する溶媒は、エタノールなどのアルコール類やアセトンを使用して下さい。アセトンの方が 脱脂力が強く洗浄効果があります。

## Ⅷ-1-2 分解洗浄 I

長期間使用した事によりイオン源内に残留したサンプル、又は残り易いサンプルのバックグランドが測定に影響をおよぼす場合は、日常的な洗浄に加えベーパライザー部分の分解洗浄も行って下さい。脱脂力の強いアセトンで洗浄を行って下さい。

## 用意する工具

- 6 角レンチ(1.5mm/2.5mm)
- スパナ(6.35mm)
- 1)カバーを下にして作業台に置き、丸で囲んだ3個のねじを6角レンチ(2.5mm)で緩めます。 カバーを上にして置き直し、カバーを上方に持ち上げ外します。









2) ヒーター及び白金測温体のナイロンコネクターを抜き、ドライガス配管のナットをスパナ(8mm)で緩めます。丸で囲んだ水平方向の2個のねじを6角レンチ(2.5mm)で外し、ベーパライザーを抜き取ります。











3) ヒートコンダクターからヒーター及び白金測温体を外します。









丸で囲んだ2個のねじを6角レンチ(2.5mm)で外し、キャップ<sub>(定期交換品)</sub>を手前に引き抜きます。







ヒートコンダクター側面の3個の止めねじを6角レンチ(1.5mm)で緩め、ヒーター及び白金測温体を外します。



ヒートインシュレータ<sub>(定期交換品)</sub>を抜き取ります。 ヒートコンダクター、ヒートインシュレーター、止めねじ、ヒーターの金属部分をアセトンで拭取洗浄します。

4) 丸で囲んだ熱輻射カバーを固定しているねじ(4個)を6角レンチ(2.5mm)で外し、熱輻射カバーを外し、輻射カバー内外面と取付ねじを拭取洗浄します。



- 5) その他イオン化室内の部品、スプレーヤーの金属部分、オリフィス1及びドレンポートを全てアセトンで 拭取洗浄して下さい。
- 6) 洗浄後、分解したのと逆の手順で組み立てて下さい。尚白金測温体を取り付ける際、止めねじは軽く締めて下さい。締め付けが強過ぎると白金測温体の測温部を破損する可能性があります。

### Ⅷ-1-3 分解洗浄Ⅱ

日常的な洗浄及び分解洗浄1)で感度が復帰しなくなった場合、オリフィス1裏側、リングレンズ、オリフィス2 先端の汚れを落とす必要があります。汚れの度合はお客様の使用状況により異なりますが、1ヵ月程度を目安に下記 洗浄を行って下さい。

## 用意する工具

- 6 角レンチ(1.5mm/3mm)
- ・ オリフィス 1 着脱用治具(6 角穴付きボルト M5×40 2 本)
- 1)真空排気停止 正面パネルの VENT ボタンを押し真空排気を停止します。VENT 完了に 10 分を要します。
- 2) VENT が完了したらイオン源を取り外します。
- 3) オリフィス1を固定しているねじ2本を6角レンチ(3mm)で外し、着脱用治具を使用して手前に引き外します。





4) リングレンズを固定しているねじ2本を6角レンチ(1.5mm)で外し、リングレンズと インシュレーター (定期交換品) を外します。







5) オリフィス1の裏側、リングレンズ及びオリフィス2の先端がイオン焼けを起こしていないか確認し、イオン焼けしていないようならこの手順を進め、イオン焼けを起こしているなら〒-1-4 <u>分解洗浄</u>へ進んで下さい。





6) セラミックのインシュレーターを除き、分解した部品をアセトンで拭取洗浄します。

## Ⅲ-1-4 分解洗浄Ⅲ

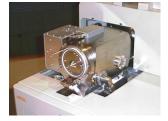
オリフィス1の裏側、リングレンズ及びオリフィス2の先端がイオン焼けを起こしているような汚れのひどい場合は、拭取洗浄に加えて研磨、及びイオンガイドの先端部の簡単な洗浄が必要です。汚れの度合はお客様の使用状況により異なりますが、3ヵ月程度を目安に下記洗浄を行って下さい。

### 用意する工具

- 6 角レンチ(1.5mm/2.5mm/3mm/6mm)
- ・ +ドライバー
- エメリーペーパー(#1000 以上)
- 1) 下図に示すカバーを外します。左右側面の固定ねじ2個を6角レンチ(3mm)で外し、イオン源ガイドピンを避けられる位置まで手前に引き上に持ち上げます。







2) ケーブルコネクターとドレンホースを外します。





3) 固定ねじ(2個)を6角レンチ(6mm)で緩め、ユニットを手前に引き外し、作業台にのせます。









4) オリフィス1を外し、リング<sub>(定期交換品)</sub>を外します。









5) オリフィス2の固定ねじ3個を6角レンチ(3mm)で外し、インシュレーター (定期交換品) 3個とオリフィス2を取り外します。







6) リングレンズを外し、リングレンズのインシュレーターも取り外します。







7) 各部品をアセトンで拭取洗浄します。

汚れのひどい部分、特にイオン焼けを起こしている箇所はエメリーペーパーで研磨し、アセトンで拭取洗浄します。この際オリフィスの両端のエッジは元の形状を崩さないように注意して下さい。形状が崩れると感度が低下する場合があります。

プラスチック製のインシュレーターは、必ず拭取洗浄して下さい。溶媒に浸漬すると膨潤して寸法変化を起こします。

碍子の汚れがひどい時は交換して下さい。溶媒で拭くと絶縁不良を起こします。

8) イオンガイド先端の洗浄



イオンガイドの先端から 50mm 程度を溶媒で拭取洗浄して下さい。

イオンガイドが曲がらないよう注意して下さい。分解能が低下する恐れがあります。

また拭取に使用した洗浄紙の毛羽が残らないように注意して下さい。放電を起こし感度が不安定になる可能性があります。

イオンガイドがイオン焼けを起こしている場合は専門のサービス員による分解洗浄が必要ですので、お近くの日本電子データム(株)サービスセンターに分解洗浄を依頼して下さい。

## Ⅲ-2 ヒーター及び白金測温体交換要領

オリフィス及びベーパライザーに使用されているヒーター及び白金測温体は定期交換の必要ありません。機能しなくなった時に日本電子データムより購入していただき、下記要領で交換して下さい。

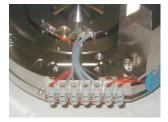
### ₩-2-1 オリフィス

### 用意する工具

- 6 角レンチ(1.5mm/2.5mm/3mm)
- ・ ードライバー
- 1)分解洗浄Ⅲの④の手順まですすめます。
- 2) コネクターカバーを外します。







3) ヒートコンダクターに関る左5箇所のケーブルの固定を緩めます。





4) 固定しているねじ3個を緩めヒートコンダクターを外します。





5) ヒーターを交換する場合、固定している止めねじ2個を外し引き抜き、新しいヒーターに交換します。





6) 白金測温体を交換する場合、固定している止めねじを外し引き抜き、新しい白金測温体に交換します。 取り付ける際、止めねじは軽く締めて下さい。締め付けが強過ぎると白金測温体の測温部を破損する可能性 があります。



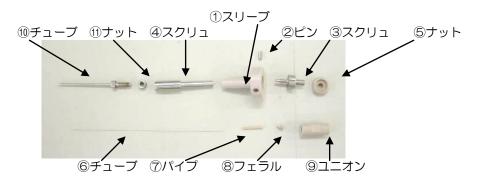


# Ⅷ-2-2 ベーパライザー

分解·交換要領は<u>分解洗浄 I</u>の①~③と同じですので参照して下さい。

# Ⅲ-3 スプレーヤーの分解及び組立要領

スプレーヤーは以下の部品から構成されています。



## 用意する工具

- スパナ(6mm×2/8mm)
- 1) ①スリーブに②ピンを挿入します。



2) ①スリーブに③スクリュを挿入します。



3) ④スクリュを①スリーブに通し、③スクリュにねじ込みます。



4) ⑤ナットを③スクリュにねじ込みます。



5) ⑥チューブを⑦パイプに通し、⑧フェラルを⑦パイプに通します。



6) ③スクリュを通し、⑥パイプと⑦チューブの端面を合わせ、⑧フェラルから 3~4mm 出た位置に合わせます。





7) ⑨ユニオンをねじ込み、手締めで締まったところから 1/2 回転締め込み、⑥チューブが固定されている事を確認します。手で引っ張って軽く抜けるようであれば更に締め込みます。手締めで十分締め込めますが、 ⑨ユニオンにスパナ(8mm)を使用しても構いません。



8) ⑪チューブに⑪ナットを 2mm ほど残しねじ込みます。



9) ⑪チューブを④スクリュにねじ込みます。





10) ⑥チューブの⑪チューブからの突き出し量を任意の位置に合わせ、⑪ナットを固定します。 分解はこの逆の手順で行って下さい。

### Ⅲ-4 消耗品及び定期交換部品について

イオン源及びイオン導入部に使用されているプラスチック部品は、高温又は高温·真空下で使用されており、長期的に材質劣化や変形を起こします。特にオリフィス・リングレンズ・ベーパライザーの固定に関るインシュレーターの材質劣化や変形は、それぞれの位置関係にずれを生じさせ、感度やレンズ電圧配分の変化という現象を引き起こす可能性があります。「消耗品·定期交換部品リスト」を参照していただき、定期的に交換して下さい。

#### Ⅷ-4-1 オリフィス

オリフィス2及びヒートコンダクターの固定に使用されるインシュレーター(下図左) リングレンズの固定に使用されるインシュレーター(下図右) 分解要領は、分解洗浄Ⅲを参照して下さい。





#### Ⅷ-4-2 イオン源覗き窓

覗き窓のシール・固定に使用しているパッキンを交換します。以下に分解要領を説明します。





#### 用意する工具

- ・ +ドライバー
- スパナ (8mm)
- 1) 分解洗浄 [の①の手順でイオン源カバーを外します。
- 2) 覗き窓の保護カバーを固定している4個のねじを+ドライバーを使用して外します。





3) ガラス窓の固定プレートを固定している支柱4個をスパナ(8mm)を使用して外します。





4) パッキンとガラス窓を外します。







₩-4-3 スプレーヤーガイド

スプレーヤーのガイドを交換します。以下に分解要領を説明します。





用意する工具

- ·6角レンチ(2.5mm)
- 1) 分解洗浄 [の①の手順でイオン源力バーを外します。
- 2) スプレーヤー位置調節部のナットを外します。





3)スプレーヤー位置調節部の固定ねじ4個を6角レンチ(2.5mm)で外し、横にずらします。





4) スプレーヤーのガイドを抜き取ります。

